

OLED 用処理装置

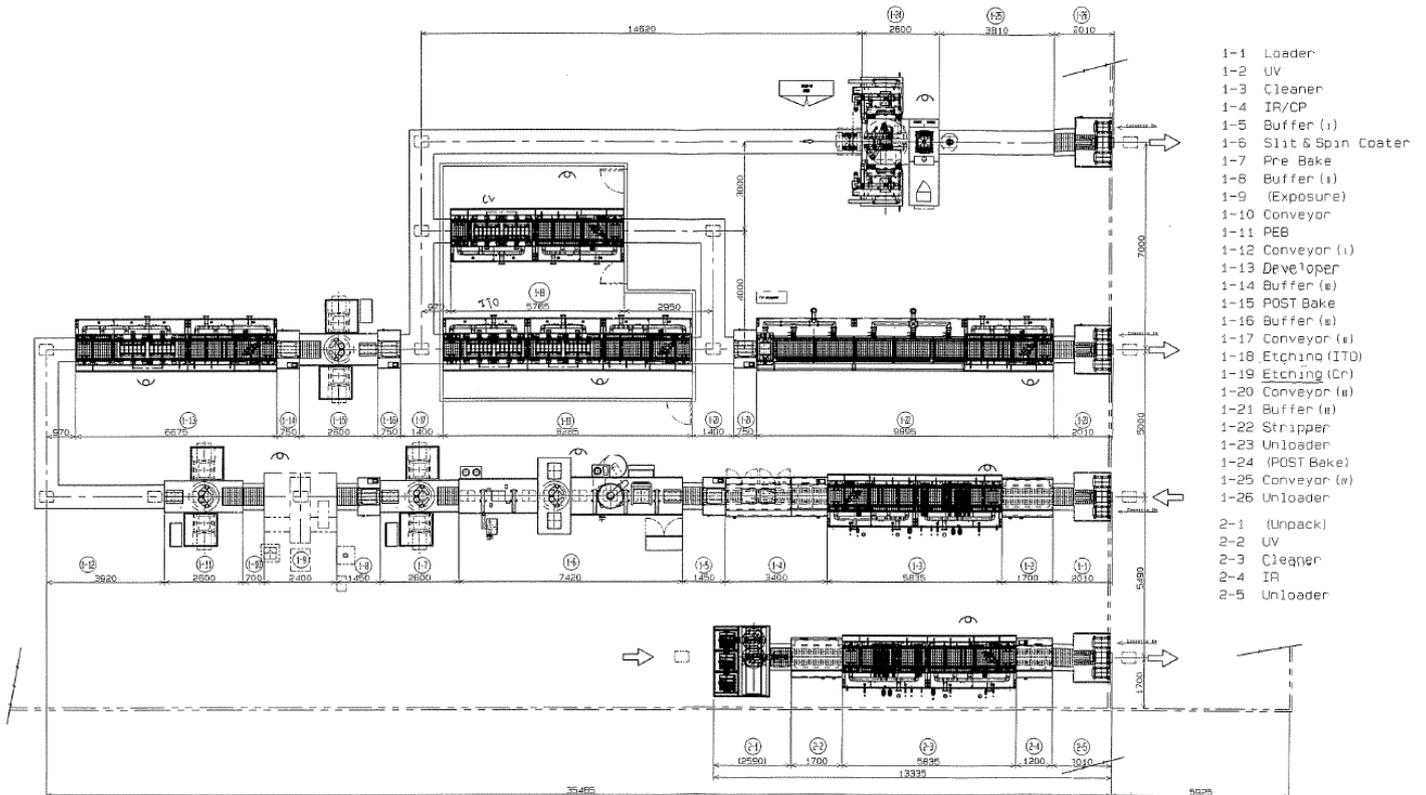
<概要>

本装置は有機EL製造ラインの洗浄装置を提供しています。基板サイズは370×470×1.1を処理致します。
装置としては受入洗浄・純水洗浄・現像装置・ハクリ装置・Crエッチング装置・ITOエッチング装置

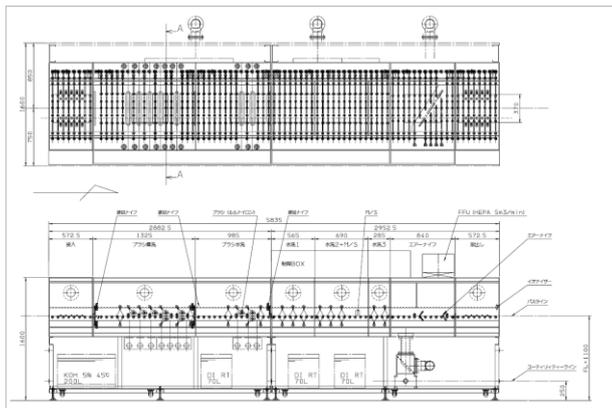
<主な仕様>

1. 被洗浄物 : ガラス基板 370×470 厚み 0.6~1.1t
2. 処理方法 : 枚用処理
3. 処理速度 : 0.6~5.0m/min (可変)
4. パスライン : FL+1100mm

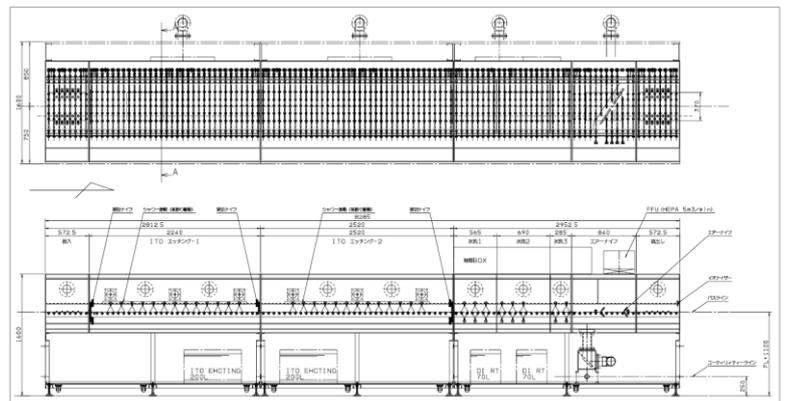
<全体レイアウト図 (イメージ)>



<外観図 (イメージ)>



純水装置



ITOエッチング装置

<写真>



純水装置



Crエッチング装置



剥離装置



現像装置



受入洗浄装置



ITOエッチング装置



ブラシ部



エアナイフ部